

高真空蒸着装置 RD-1300R



高真空蒸着装置RD-1300RはAu成膜専用の蒸着装置です。

基板加熱はカートリッジヒーターによる基板直接加熱で、最高650℃まで加熱可能。

水晶振動式膜厚計も標準で搭載しております。

高真空蒸着装置RD-1300R仕様

- 到達圧力 $\times 10^{-5}$ 台Pa以下※ワーク挿入時・常温時
- 排気速度 6.0×10^{-5} Pa迄本引開始後30分以内※ワーク挿入時・常温時
- 真空漏洩量 1.0×10^{-10} Pa・m³/sec Heリークデテクター検査
- 真空室径 $\phi 300$ mm×300mmH 硬質ガラス
- 蒸着機構 抵抗加熱方式1対(ポート)
AC10V0~250A
制御方式:サイリスタ制御
電流計・可変ボリューム
- 基板形状 110mm×90mm 1枚【ご希望形状に対応可能】
- 膜厚計 水晶振動式膜厚計
- 真空排気系 油回転ポンプ:200L/min[60Hz]
油拡散ポンプ:500L/sec水冷バツフル付
- 真空計 ピラニ真空計/電離真空計
- 操作方法 手動
- ユーティリティ 電気:AC200V単相30A
冷却水:5L/min以上0.1MPa以上0.15MPa以下25℃以下循環
装置本体寸法:1,200mmW×765mmD×2,000mmH以内
- オプション ガス導入機構(マスフローコントローラ付)
他、多数のオプション付加&カスタマイズ可能